【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和3年11月18日(2021.11.18)

【公表番号】特表2021-507866(P2021-507866A)
【公表日】令和3年2月25日(2021.2.25)
【年通号数】公開・登録公報2021-010
【出願番号】特願2020-533576(P2020-533576)
【国際特許分類】
Ｃ０３Ｂ　37/029　(2006.01)
Ｆ２７Ｄ　7/06　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０３Ｂ　37/029
Ｆ２７Ｄ　7/06　Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年10月6日(2021.10.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
円周及び直径を有する加熱される目的物（３ｐ）、ならびに前記目的物が高温炉（６ｐ）に出入りする前記炉の加熱要素（４ｐ）の両方を汚染物質から保護する可変封止（１００）であって、
第１の支持リング（１１０）と、
距離によって前記第１の支持リングから分離される第２の支持リング（１１２）と、
前記第１の支持リングと前記第２の支持リングとの間の距離を制御する１つ以上の構成要素と、
中心を有し、前記第１の支持リング及び前記第２の支持リングに取り付けられ、前記目的物が前記炉に出入りする所に配置され、前記目的物の少なくとも一部を取り囲む、耐熱性に優れたファブリック円筒体（１４０）と、
前記ファブリック円筒体のほぼ中心に係合して、前記１つ以上の構成要素が前記第１の支持リングと前記第２の支持リングとの間の前記距離を減少させる際、前記ファブリック円筒体を閉じ、前記１つ以上の構成要素が前記第１の支持リングと前記第２の支持リングとの間の距離を増加させる際、前記ファブリック円筒体を開き、前記ファブリック円筒体が、前記目的物の前記直径に関係なく、前記目的物の前記円周と連続的に接触する機構と、
を備える、前記可変封止。
【請求項２】
請求項１に記載の可変封止（１００）を使用して、円周及び直径を有するガラス体（２０）からガラス母材（３ｐ）を作製するシステム（２００）であって、該システムは、前記ガラス体を収容する第１開口部、前記ガラス母材が出る第２開口部（８ｐ）、及び前記ガラス体を加熱する加熱要素（４ｐ）を有する加熱ゾーンを画定する装置（１０）を含み、前記可変封止は、前記ガラス体と、前記第１開口部、前記第２開口部、または両方の開口部に近接する前記加熱要素との両方を汚染物質から保護する、システム。
【請求項３】
前記構成要素が、

前記第１の支持リング及び前記第２の支持リングを接続する少なくとも１つのエアシリンダ（１１４）であって、前記少なくとも１つのエアシリンダが、第１端及び第２端を備え、前記第２の支持リングに接続する本体と、前記第１の支持リングに接続して、前記本体に摺動可能に配置されて、前記本体から延在し、前記本体の中に収縮する延長棒（１１５）と、を有する、前記少なくとも１つのエアシリンダ（１１４）と、
圧縮空気を受けると、第１の圧縮空気マニホールド（１２０）が、前記第１の支持リング及び前記第２の支持リングを近づけて、前記第１の支持リングと前記第２の支持リングとの間の前記距離を減少させるように、前記少なくとも１つのエアシリンダの前記本体の前記第１端に接続される、前記第１の圧縮空気マニホールド（１２０）と、
圧縮空気を受けると、第２の圧縮空気マニホールド（１３０）が、前記第１の支持リング及び前記第２の支持リングを離れさせて、前記第１の支持リングと前記第２の支持リングとの間の前記距離を増加させるように、前記少なくとも１つのエアシリンダの前記本体の前記第２端に接続される、前記第２の圧縮空気マニホールド（１３０）と、
を含む、請求項１に記載の可変封止（１００）または請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記機構が、前記ファブリック円筒体に巻かれて、前記ファブリック円筒体を閉じるために付勢されるコイルばね（１５０）を含む、請求項１もしくは３に記載の可変封止または請求項２もしくは３に記載のシステム。
【請求項５】
前記機構が、
前記ファブリック円筒体の周囲に巻かれるケーブル（１６０）であって、前記ケーブルが、定力リトラクタ（１６２）に対して取り付けた一端及びクランプ（１７２）に対して取り付けた他端を有する、前記ケーブル（１６０）を含み、
前記定力リトラクタが前記ケーブルを内向きに引っ張り、前記ファブリック円筒体の周囲の前記ケーブルをきつく締める、または、前記ケーブルを解放し、前記ファブリック円筒体の周囲の前記ケーブルをゆるめることができる、請求項１もしくは３に記載の可変封止または請求項２もしくは３に記載のシステム。
【請求項６】
前記定力リトラクタ及び前記クランプが、前記ファブリック円筒体の両側の互いの真向かいに位置し、
前記機構が、前記定力リトラクタが摺動する第１の支持棒（１６４）及び前記クランプが摺動する第２の支持棒（１７４）を更に含み、
前記第１の支持リングと前記第２の支持リングとの間の前記距離が変化する際、前記定力リトラクタ及び前記クランプが前記ファブリック円筒体の前記中心の動きに続くのを可能にする、請求項５に記載の可変封止または請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
前記可変封止によって保護される前記ガラス母材のような前記目的物の直径が、約５０～２１０ｍｍの間である、請求項２に記載のシステム。
【請求項８】
前記ファブリック円筒体の前記ほぼ中心に位置する、バンド（１４２）、ベルト（１４４）もしくはリング（１４６）のうちの１つ、または任意の組み合わせを更に含み、
前記ガラス母材のような前記目的物と前記ファブリック円筒体との間の封止を改善するか、前記機構による摩耗から前記ファブリック円筒体を保護する、またはその両方である、請求項２または７に記載のシステム。
【請求項９】
第１のクランプリング（１２６）及び第２のクランプリング（１２８）を更に含み、
前記第１のクランプリングが、前記ファブリック円筒体を前記第１の支持リングに取り付け、前記第２のクランプリングが、前記ファブリック円筒体を前記第２の支持リングに取り付ける、請求項１、３－６のいずれか１項に記載の可変封止または請求項２－８のいずれか１項に記載のシステム。

【請求項１０】
前記ファブリック円筒体が、織布シリカ、カーボンファイバまたはアルミノケイ酸塩で作製されている、請求項１、３－６、９のいずれか１項に記載の可変封止または請求項２－９のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
前記第２の支持リングに取り付けられ、前記ファブリック円筒体を取り囲み、前記第１の支持リングが当該筐体の中で移動するのを可能にし、及び大気より高い気圧のガスを受ける筐体（１８０）を更に含む、請求項１、３－６、９－１０のいずれか１項に記載の可変封止または請求項２－１０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
前記第１の支持リングと前記第２の支持リングとの間の前記距離を制御する１つ以上の構成要素を指揮するコントローラ（８８）を更に含む、請求項１、３－６、９－１１のいずれか１項に記載の可変封止または請求項２－１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
円周及び直径を有する加熱される目的物、ならびに前記目的物が高温炉に出入りする前記炉の加熱要素の両方を汚染物質から保護するプロセスであって、
可変封止を提供することであって、
第１の支持リングと、
距離によって前記第１の支持リングから分離される第２の支持リングと、
中心を有し、前記第１の支持リング及び前記第２の支持リングに取り付けられている耐熱性に優れたファブリック円筒体と、
前記ファブリック円筒体のほぼ中心に係合している機構と、
を有する、前記可変封止を提供することと、
前記可変封止が前記目的物の少なくとも一部を取り囲むように、前記目的物が前記炉に出入りする場所に前記可変封止を配置することと、
前記第１の支持リングと前記第２の支持リングの間の前記距離を制御することと、
前記ファブリック円筒体が、前記目的物の前記直径に関係なく、前記第１の支持リング及び前記第２の支持リングを一緒に移動させることにより、前記目的物の前記円周と連続的に接触して、前記機構が、前記ファブリック円筒体をしっかり締めて、前記第１の支持リング及び前記第２の支持リングを移動させて離れるのを可能にし、前記機構が、前記ファブリック円筒体をゆるめるのを可能にするのを確実にすることと、
を含む、前記プロセス。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００８】
上述の目的を達成するために、加熱される目的物及び高温炉の加熱要素の両方を汚染物質から保護するための、可変封止が提供されている。封止は、距離で区別される、第１の支持リング及び第２の支持リングを備える。１つ以上の構成要素は、２つの支持リングの間の距離を制御する。耐熱性に優れたファブリック円筒体は、支持リングに取り付けられて、目的物が炉に出入りする所に配置されて、目的物の少なくとも一部を取り囲む。機構はファブリック円筒体のほぼ中心に係合して、１つ以上の構成要素が２つの支持リングの間の距離を減少させる際、ファブリック円筒体を閉じ、１つ以上の構成要素が２つの支持リングの間の距離を増加させる際、ファブリック円筒体を開き、それによって、ファブリック円筒体は、目的物の直径に関係なく、目的物の円周と連続的に接触する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９

【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
円周及び直径を有するガラス体からガラス母材を作製するシステムを、更に提供する。システムは、ガラス体を収容する第１の開口部、ガラス母材が出る第２の開口部、及びガラス体を加熱する加熱要素を有する加熱ゾーン、を画定する装置を含む。システムは、汚染物質からガラス体及び加熱要素の両方を保護するための可変封止も含む。封止は、距離で区別される、第１の支持リング及び第２の支持リングを備える。１つ以上の構成要素は、２つの支持リングの間の距離を制御する。耐熱性に優れたファブリック円筒体は、支持リングに取り付けられて、装置の第１開口部、第２開口部または両方の開口部に近接して配置されて、ガラス体の少なくとも一部を取り囲む。機構はファブリック円筒体のほぼ中心を結合させて、１つ以上の構成要素が２つの支持リングの間の距離を減少させる際、ファブリック円筒体を閉じ、１つ以上の構成要素が２つの支持リングの間の距離を増加させる際、ファブリック円筒体を開き、それによって、ファブリック円筒体は、ガラス体の直径に関係なく、ガラス体の円周と連続的に接触する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
また更に、円周及び直径を有する加熱される目的物、ならびに目的物が炉に出入りする高温炉の加熱要素の両方を汚染物質から保護する処理も提供される。処理は、以下の工程、（ａ）第１の支持リングと、距離によって第１の支持リングから分離される第２の支持リングと、中心を有し、第１の支持リング及び第２の支持リングに取り付けられている耐熱性に優れたファブリック円筒体と、ファブリック円筒体のほぼ中心に係合している機構と、を有する可変封止を提供することと、（ｂ）可変封止が目的物の少なくとも一部を取り囲むように、目的物が炉に出入りする場所に可変封止を配置することと、（ｃ）第１の支持リングと第２の支持リングの間の距離を制御することと、ならびに（ｄ）ファブリック円筒体が、目的物の直径に関係なく、第１の支持リング及び第２の支持リングを一緒に移動させることにより、目的物の円周と連続的に接触して、機構が、ファブリック円筒体をしっかり締めて、第１の支持リング及び第２の支持リングを移動させて離れるのを可能にし、機構が、ファブリック円筒体をゆるめるのを可能にするのを確実にすることと、を含む。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
耐熱性に優れたファブリック円筒体１４０は、上部支持リング１１０及び下部支持リング１１２に取り付けられる。任意の好適な接着機構で十分であるが、取り付けは、（ａ）上側クランプリング１２６と上部支持リング１１０の間、及び（ｂ）下部クランプリング１２８と下部支持リング１１２との間、の両方とファブリック円筒体１４０を留めることによりなされ得る。ファブリック円筒体１４０は、ファブリックの円筒からなる。多くの異なるファブリックを、円筒を形成するために使用できる。光ファイバ母材または光ファイバを製造する工程（高温炉を使用する）で、使用するファブリックは、これらの温度に耐えることができなければならない。織布シリカファブリックまたはカーボンファイバのファブリックが、これらの条件の下で使用できる。更により高温での露出のために、アルミノケイ酸ファブリックを使用することも可能である。